# Sprawozdanie

Projektowanie Struktur Półprzewodnikowych

Jakub Zolich

Nr. Albumu: 251120

Rok/semestr: III rok, 6 semestr

Materiały: AlGaAsSb

#### Opis systemu materiałowego

Badany materiał można podzielić na związki grup III-V czyli tzw. "materiały binarne": AlSb; GaSb; AlAs; GaAs.

- Antymonek glinu (AlSb) ma swoje zastosowanie w produkcji detektorów promieniowania rentgenowskiego oraz gamma. Szerokość przerwy wzbronionej wynosi 1,6 eV w temperaturze 300 K [1]
- Antymonek galu (GaSb) jest półprzewodnikiem stosowanym w produkcji detektorów podczerwieni, podczerwonych diod elektroluminescencyjnych, laserów oraz tranzystorów.
  Pracuje na średnich oraz długich falach podczerwonych. Szerokość przerwy wzbronionej wynosi 0,726 eV w temperaturze 300 K [2]
- Arsenek glinu (AlAs) jest bardzo podobny do arsenku galu, z tą różnicą, że ma szerszą przerwę wzbronioną (2,12 eV). Ma swoje zastosowanie w tworzeniu oprzyrządowania optoelektrycznego, takich jak diody elektroluminescencyjne. [3]
- Arsenek galu (GaAs) jest drugim, zaraz po krzemie, najczęściej wykorzystywanym półprzewodnikiem w elektronice. Jego zaletą jest wyższa odporność na działanie pola elektromagnetycznego. Urządzenia oparte na tym materiale mogą pracować nawet na częstotliwościach wysokości 250 GHz, a sam może służy nawet jako emiter fal terahertzowych. Szerokość przerwy wzbronionej wynosi 1,424 eV w temperaturze 300 K [4]

Oprócz tego można podzielić badany materiał na materiały niebinarne, składające się z trzech pierwiastków: GaAlSb; GaAlAs; Al.AsSb; GaAsSb.

- GaAlSb jest to heterostruktura wykorzystywana do budowy laserów oraz detektorów, cechująca się bardzo niskimi stratami oraz niskim współczynnikiem dyspersji. [5]
- GaAlAs jest to materiał półprzewodnikowy, którego szerokość przerwy wzbronionej waha się od 1,42 do 2,16 eV w zależności od domieszkowania. Jest wykorzystywany do budowy laserów opartych na arsenku galu (GaAs). Pracuje w zakresie fal podczerwonych. [6]
- AlAsSb jest często wykorzystywany do budowy detektorów promieniowania rentgenowskiego oraz gamma oraz laserów kaskadowych emitujących fale o długości 4 – 5,4 µm. [7]
- GaAsSb -materiał wykorzystywany do budowy diod podczerwonych oraz detektorów fal podczerwonych. Szeroko stosowany w aparaturze wojskowej, astronomicznej oraz mechatronice. [8]

## Opis modeli i metod

Interpolacja jest to metoda numeryczna polegająca na budowaniu w zadanym obszarze tzw. funkcji interpolacyjnej, która przyjmuje w nim z góry zadane wartości w ustalonych punktach nazywanych węzłami. Stosowana jest zarówno w metodach numerycznych (np. przy obliczaniu całek ze skomplikowanych funkcji), jak i w naukach doświadczalnych przy budowaniu funkcji na podstawie danych pomiarowych w skończonej liczbie punktów (np. w meteorologii przy sporządzaniu map synoptycznych).

Wzór stechiometryczny dla mieszanin trójskładnikowych III-V-V:

$$AB_xC_{1-x}$$

Wzór interpolacyjny dla mieszanin trójskładnikowych III-V-V:

$$P_{ABC}(x) = x \cdot P_{AB} + (1-x) \cdot P_{AC} - x \cdot (1-x) \cdot b_{ABC}$$

Wzór stechiometryczny dla mieszanin trójskładnikowych III-III-V:

$$A_x B_{1-x} C$$

Wzór interpolacyjny dla mieszanin trójskładnikowych III-III-V:

$$P_{ABC}(x) = x \cdot P_{AC} + (1-x) \cdot P_{BC} - x \cdot (1-x) \cdot b_{ABC}$$

Wzór stechiometryczny dla mieszaniny czteroskładnikowej:

$$A_xB_{1-x}C_yD_{1-y}$$

Wzór interpolacyjny mieszaniny czteroskładnikowej:

$$P_{ABCD}(x,y) = [x \cdot (1-x) \cdot (y \cdot P_{ABC} + (1-y) \cdot P_{ABD}) + y \cdot (1-y) \cdot (x \cdot P_{ACD} + (1-x) \cdot P_{BCD})] \cdot (x \cdot (1-x) + y \cdot (1-y))^{-1}$$

## Wyniki i dyskusja

Dla czteroskładnikowego materiału AlGaAsSb zostały obliczone następujące parametry:

- 1. Wartości przerwy energetycznej Eg
- 2. Parametr sieci a<sub>lc</sub>
- 3. Rozszczepienie spin-orbity  $\Delta$ so
- 4. Masa dziur ciężkich m<sub>HH</sub>
- 5. Masa dziur lekkich m<sub>LH</sub>
- 6. Masa efektywna elektronów me\*
- 7. Wartość wierzchołka pasma walencyjnego VBO

Do obliczeń wykorzystano stałe dla materiałów binarnych, pozyskane ze źródeł literaturowych: Eg,  $a_{lc}$ ,  $\Delta so$ , VBO – [18];  $me^*$ ,  $m_{HH}$ ,  $m_{LH}$  – [19].

Nazwa	AlAs	GaAs	AlSb	GaSb
Eg (eV)	3.099	1.519	2.386	0.812
alc (Å)	5.6611	5.65325	6.1355	6.0959
$\Delta_{\text{so}}\left(\mathrm{eV}\right)$	0.28	0.341	0.676	0.76
VBO (eV)	-1.33	-0.80	-0.41	-0.03
тнн	0.81	0.55	0.9	0.37
$m_{LH}$	0.16	0.083	0.13	0.043
me*	0.124	0.067	0.14	0.039

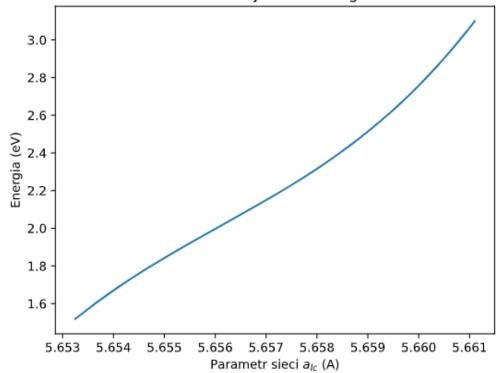
Tabela 1 – Parametry materiałów binarnych dla AlGaAsSb

Parametr	AlGaAs	AlGaSb	AlAsSb	GaAsSb
Eg (eV)	-0.127+1.310x	-0.044+1.22x	0.8	1.43
$\Delta_{\text{so}}\left(\mathrm{eV}\right)$	0	0.3	0.15	0.6
VBO (eV)	0	0	-1.71	-1.06

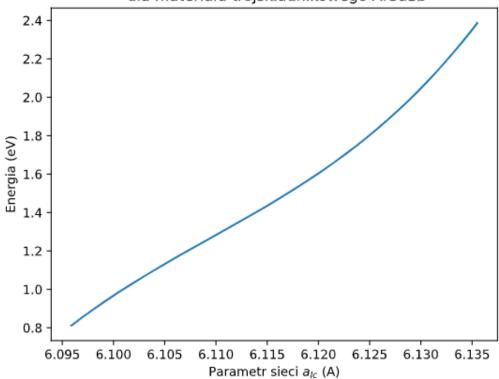
Tabela 2 – Parametry bowingu dla materiałów trójskładnikowych [18]

Obliczenia zostały wykonane dla domieszkowania składnikami z grupy III oraz V, dla odpowiedniej zawartości molowej. Krok zmiany zawartości molowej wynosił 0.2. Otrzymane wyniki zostały zaprezentowane na poniższych wykresach.

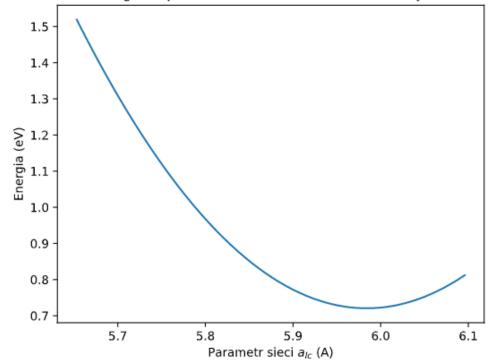
#### Wykres zależności energii od paramteru sieci a dla materiału trójskładnikowego AlGaAs

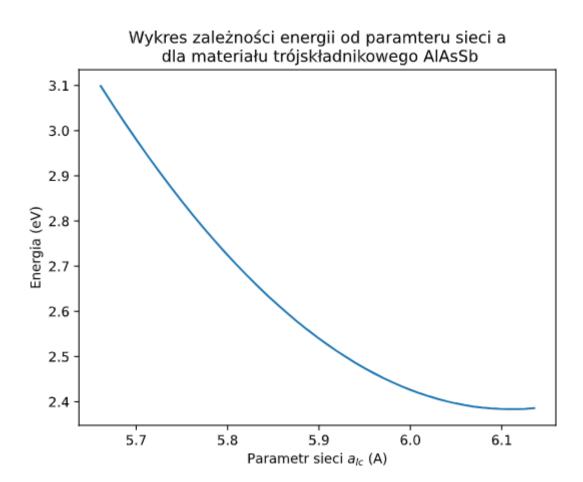




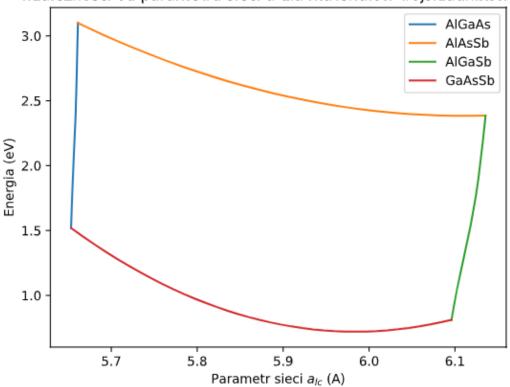


Wykres zależności energii od paramteru sieci a dla materiału trójskładnikowego GaAsSb

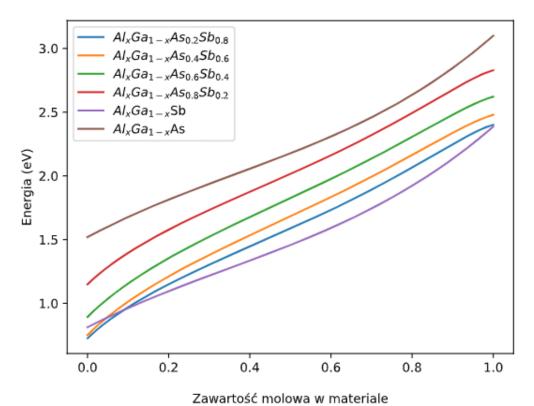




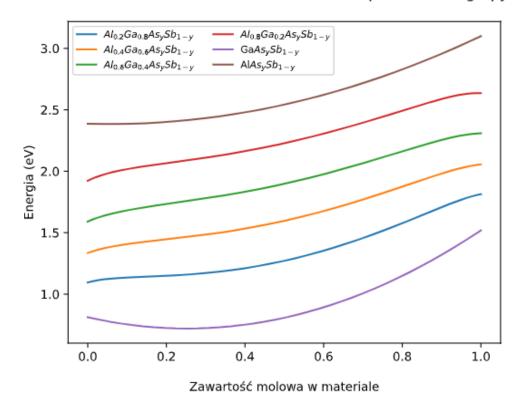
Wykres zminay szerokości przerwy energetycznej wzależności od parametru sieci a dla materiałów trójskładnikowych



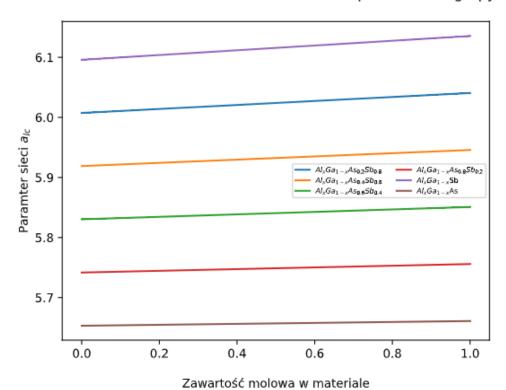
Wartość przerwy energetycznej w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy III



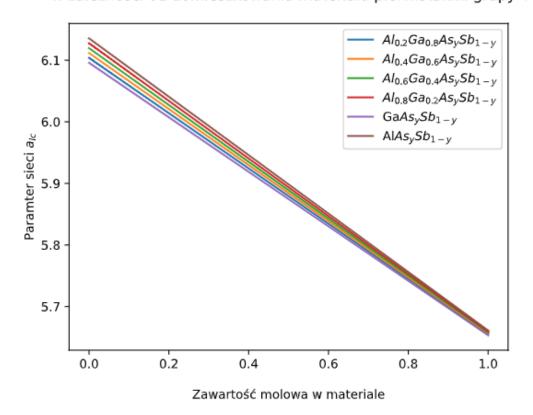
#### Wartość przerwy energetycznej w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy V



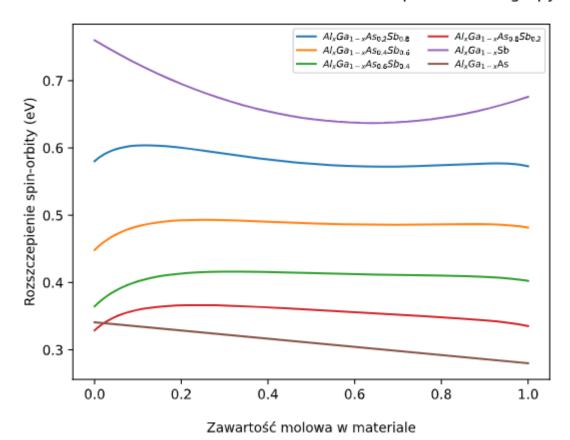
Wartość parametru sieci w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy III



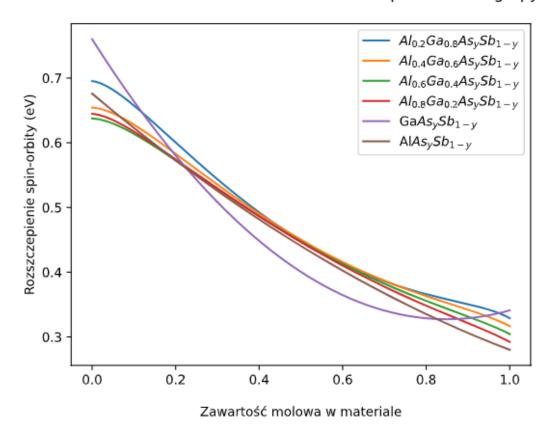
#### Wartość parametru sieci w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy V



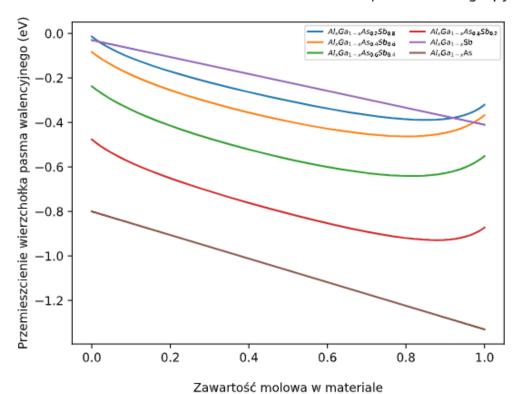
Rozszczepienie spin-orbity w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy III



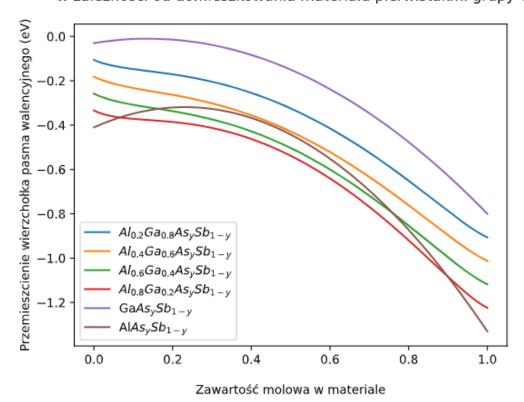
#### Rozszczepienie spin-orbity w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy V



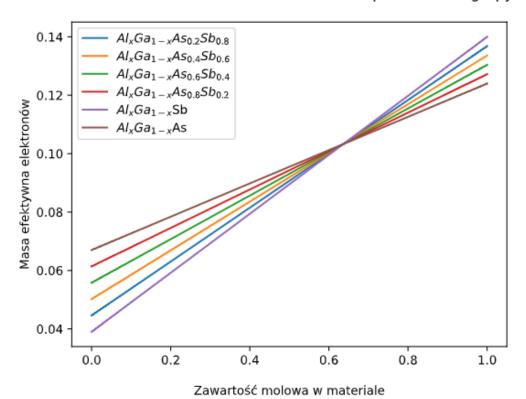
Przemiszczenie wierzchołka pasma walencyjnego w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy III



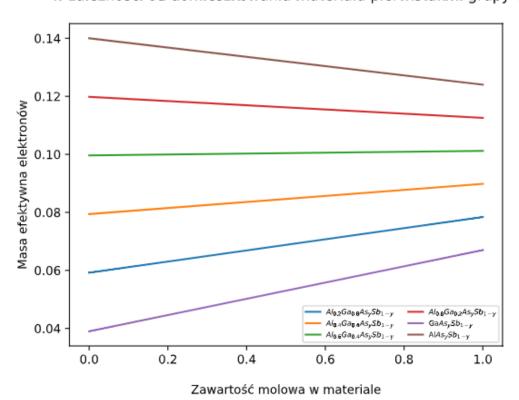
#### Przemiszczenie wierzchołka pasma walencyjnego w zalezności od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy V



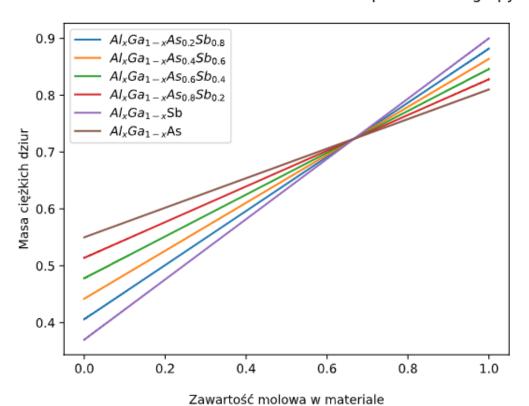
Zmiana masy efektywnej elektronów w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy III



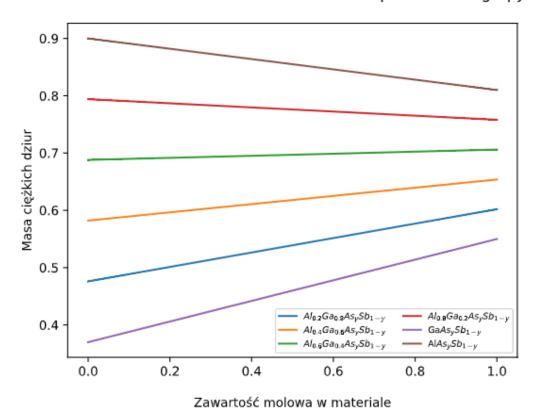
## Zmiana masy efektywnej elektronów w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy V



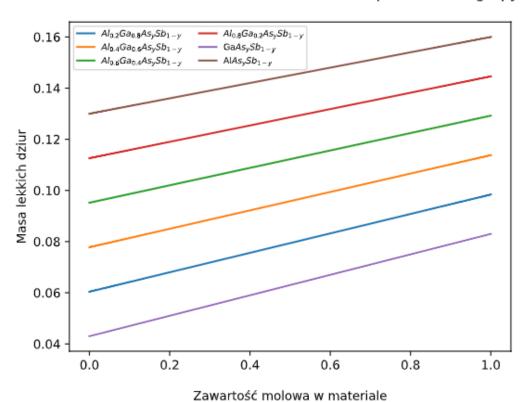
Zmiana masy ciężkich dziur w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy III



Zmiana masy ciężkich dziur w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy V



Zależność masy lekkich dziur w zaleznosci od domieszkowania materiału pierwistakmi grupy V



## Źródła:

- 1. Juang, B.-C., Chen, A., Ren, D. K., Liang, B. L., Prout, D. L., Chatziioannou, A. F., Huffaker, D. L., Energy-Sensitive GaSb/AlAsSb Separate Absorption and Multiplication Avalanche Photodiodes for X-Ray and Gamma-Ray Detection. Advanced Optical Materials 2019, 7
- 2. Martyniuk, P., Michalczewski, K., Tsai, T., Wu, C. and Wu, Y. (2020), A Thermoelectrically Cooled nBn Type-II Superlattices InAs/InAsSb/B-AlAsSb Mid-Wave Infrared Detector. Phys. Status Solidi A, 217: 1900522.
- 3. S. J. Eglash, H. K. Choi, InAsSb/AlAsSb double-heterostructure diode lasers emitting at 4  $\mu$ m, 1994, Applied Physics Letters
- 4. D. G. Revin, L. R. Wilson, E. A. Zibik, R. P. Green, J. W. Cockburn, M. J. Steer, R. J. Airey, M. Hopkinson,  $\lambda \sim 4-5.3~\mu m$  intersubband emission from InGaAs–AlAsSb quantum cascade structures, 2004, Applied Physics Letters
- 5. I. Vurgaftman, J. R. Meyer, L. R. Ram-Mohan, Band parameters for III-V compound semiconductors and their alloys, 2001, Journal of Applied Physics, 89
- 6. Sadao Adachi, Properties of Semiconductor Alloys: Group-IV, III–V and II–VI Semiconductors, 2009 John Wiley & Sons Ltd
- 7. J. H. Yee, S. P. Swierkowski and J. W. Sherohman, "ALSB as a High-Energy Photon Detector," in *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 24, no. 4, pp. 1962-1967, June 1977, doi: 10.1109/TNS.1977.4329136.
- 8. Witt, A.F., Becla, P., Counterman, C., DiFrancesco, J., Landahl, G., Morse, K., & Sanchez, J. (Jan 1996). Top-seed solution growth and characterization of AlSb single crystals for gamma-ray detectors Final report, 1 October 1994 30 September 1995 (DOE/NV/11627--2). United States
- 9. Y. Zhang, N. Baruch, W. I. Wang, AlAs/AlGaAs X-valley quantum-well normal-incidence infrared detectors on Si substrates, 1994, Journal of Applied Physics
- 10. Krasnok, A. E., Miroshnichenko, A. E., Belov, P. A., & Kivshar, Y. S. (2012). All-dielectric optical nanoantennas. Optics Express
- 11. R. C. Miller, B. Schwartz, L. A. Koszi, W. R. Wagner, A high-efficiency GaAlAs double-heterostructure photovoltaic detector, 1978, Applied Physics Letters
- 12. A.M. Barnett, D.J. Bassford, J.E. Lees, J.S. Ng, C.H. Tan, J.P.R. David, Temperature dependence of AlGaAs soft X-ray detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 621, Issues 1–3, 2010, Pages 453-455
- 13. A. Köck, E. Gornik, M. Hauser, W. Beinstingl, Strongly directional emission from AlGaAs/GaAs light-emitting diodes, 1990, Applied Physics Letters
- 14. J. Koeth, T. Bleuel, R. Werner and A. Forchel, "GaAlSb based VCSEL and edge emitting lasers," *Conference Proceedings. LEOS'98. 11th Annual Meeting. IEEE Lasers and Electro-Optics Society 1998 Annual Meeting (Cat. No.98CH36243)*, Orlando, FL, USA, 1998, pp. 28-29 vol.1
- 15. Chin, R., AIR FORCE DEVELOPMENT TEST CENTER EGLIN AFB FL, GaAlAsSb APD Optimization, 1984
- 16. E. G. Dierschke, "High-efficiency GaAsSb/GaAlAsSb double-heterostructure hemispherical infrared emitting diodes," in *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 26, no. 8, pp. 1210-1214, Aug. 1979
- 17. Easley, J., Martin, C.R., Ettenberg, M.H. et al. InGaAs/GaAsSb Type-II Superlattices for Short-Wavelength Infrared Detection. Journal of Elec Materi 48, 6025–6029 (2019).
- 18. M.C. Veale, S.J. Bell, D.D. Duarte, M.J. French, A. Schneider, P. Seller, M.D. Wilson, A.D. Lozinskaya, V.A. Novikov, O.P. Tolbanov, A. Tyazhev, A.N. Zarubin, Chromium compensated gallium arsenide detectors for X-ray and  $\gamma$ -ray spectroscopic imaging, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 752, 2014, Pages 6-14

- 19. G. Lioliou, A.M. Barnett, Gallium Arsenide detectors for X-ray and electron (beta particle) spectroscopy, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 836, 2016, Pages 37-45,
- 20. G. Zhao, R. N. Schouten, N. van der Valk, W. Th. Wenckebach, P. C. M. Planken, Design and performance of a THz emission and detection setup based on a semi-insulating GaAs emitter, 2002, Review of Scientific Instruments, 73
- 21. O.V Sulima, A.W Bett, Fabrication and simulation of GaSb thermophotovoltaic cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 66, Issues 1–4, 2001, Pages 533-540
- 22. Luke Ferguson, Lewis Fraas, Matched infrared emitters for use with GaSb TPV cells, 1997, AIP Conference Proceedings, 169-179
- 23. Mohammedy, Farseem M., Jamal Deen, M., Growth and fabrication issues of GaSb-based detectors, 2009, Journal of Materials Science: Materials in Electronics